

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成20年9月11日(2008.9.11)

【公開番号】特開2002-188903(P2002-188903A)

【公開日】平成14年7月5日(2002.7.5)

【出願番号】特願2001-271793(P2001-271793)

【国際特許分類】

G 01 B	11/00	(2006.01)
G 01 C	3/06	(2006.01)
G 02 B	7/02	(2006.01)
G 02 B	7/28	(2006.01)

【F I】

G 01 B	11/00	B
G 01 C	3/06	A
G 02 B	7/02	Z
G 02 B	7/11	H
G 02 B	7/11	N

【手続補正書】

【提出日】平成20年7月29日(2008.7.29)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

nが2以上の自然数であるn個の点(P)の位置の、n個の分離されたその参照位置とのずれを測定する装置であって、光源(1)と、結像光学系(2, 4, 9)と、を含み、前記結像光学系の一部(2, 4)を通過する光が、n個の点(P)全ての場所へ斜めに投影される線状の光カーペット(6)を、該光カーペット(6)が前記n個の点(P)によって定まる表面を照らすように、形成し、前記n個の点(P)の位置情報が、前記結像光学系(4, 9)を通過する光の経路情報へと変換されるように、前記n個の点(P)の各々の前記表面上の位置の前記参照位置とのずれが、前記n個の点(P)の1つによって反射された光の光路であって、参照位置にある前記1つの点(P)によって反射された光の、前記結像光学系(4, 9)を通過する光路とは異なる他の光路に一義的関係でつながり、前記装置は、反射光が結像光学系(9)の要素によって集束させられ、かつ各々が前記n個の点(P)の1つに一義的に割り当てられたn個の信号を時間的にほぼ同時にまたは並行に生成する感光性検出器(10)を含む、n個の点(P)の位置の、n個の分離されたその参照位置とのずれを測定する装置において、

前記結像光学系(4, 9)を通過する異なった光路上の、前記n個の点(P)の各々の光の経路情報が、前記異なった光路上の光の一義的に変更された光強度の形態の強度情報に変換される、位置に依存した透過性を有する、前記結像光学系(4, 9)の少なくとも1つの他の要素(8)が前記光路中で前記集束要素(9)の前に配置されていることを特徴とする、n個の点の、n個の分離されたその参照位置とのずれを測定する装置。

【請求項2】

前記光源(1)が個別の放射源である、請求項1記載の装置。

【請求項3】

前記n個の点が実質的に1つの平面または1本の直線上に位置している、請求項1また

は 2 記載の装置。

【請求項 4】

前記結像光学系(2, 4, 9)が非球面の光学素子を有している、請求項1から3のいずれか1項記載の装置。

【請求項 5】

前記感光性検出器(10)が、互いに独立した複数の感光性素子(11)でできている、請求項1から4のいずれか1項記載の装置。

【請求項 6】

前記感光性素子(11)がフォトダイオード、フォトセル、フォトマルチプライヤ、または電荷結合ディスプレイ(CCD)である、請求項5記載の装置。

【請求項 7】

前記互いに独立したn個の感光性素子(11)の少なくとも2つに対して、正確かつ一義的に、n個の点のうち少なくとも2つが割り当てられている、請求項5または6記載の装置。

【請求項 8】

前記放射源(1)が少なくとも1つの赤外線波長または可視波長を放出する、請求項1から7のいずれか1項記載の装置。

【請求項 9】

前記結像光学系がグレーウェッジ(8)またはエッジ(8)を有している、請求項1記載の装置。

【請求項 10】

前記光カーペット(6, 509)の後に配置された前記結像光学系の一部が、互いに実質的に直交する円柱対称な対称軸をもつ2つの光学素子(904, 908)を有している、請求項1から9のいずれか1項記載の装置。

【請求項 11】

位置に応じた透過性をもつ光学素子が設けられた変換平面(1006)で中間画像が生成される、請求項1から9のいずれか1項記載の装置。

【請求項 12】

前記結像光学系が反射後の光路中に少なくとも1つのビームスプリッタ(12)を有している、請求項1から11のいずれか1項記載の装置。

【請求項 13】

独立した複数の感光性素子(11)をもつ少なくとも1つの別の感光性検出器(10)が設けられており、前記互いに独立した素子の各々に、前記n個の点(P)の少なくとも1つの点、またはちょうど1つの点が割り当てられている、請求項12記載の装置。

【請求項 14】

距離計において、請求項1から13のいずれか1項記載の装置を有していることを特徴とする距離計。

【請求項 15】

個々に制御可能なn個のレーザと、互いに独立した結像光学系と、前記個々に制御可能なn個(nは自然数)のレーザの少なくとも2つについて独立した焦点移動を可能にするオートフォーカスシステムとを備える画像付け装置において、

前記オートフォーカスシステムが、請求項14記載の距離計の測定結果の関数で制御されることを特徴とする画像付け装置。

【請求項 16】

版露光器において、請求項15記載の画像付け装置を少なくとも1つの有していることを特徴とする版露光器。

【請求項 17】

印刷ユニットにおいて、請求項15記載の画像付け装置を有していることを特徴とする印刷ユニット。

【請求項 18】

印刷機において、請求項1\_7記載の印刷ユニットを少なくとも1つ有していることを特徴とする印刷機。

【請求項19】

nが2以上の自然数であるn個の点(P)の位置の、n個の分離されたその参照位置とのずれを測定する方法であって、

前記n個の点(P)で形成される表面を線状に照らす光カーペット(6)で光を前記n個の点(P)の各1つへ斜めに投影するステップと、

前記点(P)の位置情報を前記光放射の経路情報に変換するステップであって、前記n個の点(P)の各々の、前記表面上の位置のその参照位置とのずれが、前記n個の点(P)の1つによって反射された光の光路であって、参照位置にある前記1つの点(P)によって反射された光の、前記結像光学系(4,9)を通過する光路とは異なる他の光路に一義的関係でつながる、ステップと、

反射された光が前記結像光学系(9)の要素によって集束させられる感光検出器(10)上の、前記n個の点(P)の少なくとも2つの点の反射光を区別して検出するステップと

を有し、

前記各ステップがn個の点(P)の全てについて時間的に同時にまた並行して行われる

n個の点の位置の、n個の分離されたその参照位置とのずれを測定する方法において、前記位置情報を、位置に依存した透過性を有し、前記集束要素(9)の前に配置された要素(8)によって、強度情報に変換するために、異なった光路上の前記n個の点(P)の各々の光の経路情報を、前記異なった光路上の光の一義的に変更された光強度の形態の強度情報に変換することを特徴とする、n個の点の位置の、n個の分離されたその参照位置とのずれを測定する方法。

【請求項20】

前記n個の点(P)の少なくとも1つについて、反射された電磁放射の瞬間の強度を測定するステップをさらに有する、n個の点(P)の位置の、その参照位置とのずれを測定する請求項19記載の方法において、前記検出器の対応する感光性素子で測定された反射光の強度と、反射された電磁放射の瞬間の強度との比較を行うことを特徴とする、n個の点の位置の、その参照位置とのずれを測定する方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0013】

有利な実施態様では、電磁放射源が、コヒーレントまたはインコヒーレントな放射を発する個別の電磁放射源であり、その光は結像光学系の一部を通過したときに、分離した参照位置からの位置の差異を測定されるべきn個の点すべてに当たる。感光性の検出器は、互いに独立した感光性素子をn個有している。互いに独立したn個の感光性素子の各々に、参照位置からの位置のずれが測定されるべき、正確に1つの点または反射点が割り当てられる。特にこれは間隔の差異である。換言すると、n個の点が存在している領域の反射面で光が反射された後、結像光学系の他の部分による結像は、n個の点の1つの領域から反射された光が、互いに独立したn個の感光性素子の1つに一義的に従属するように設定される。n個の点の1つの位置の、参照位置とのずれは、参照位置にある点から反射された、結像光学系を通る光の光路とは異なる光路が生じることにつながる。つまり、位置情報が経路情報に変換される。結像光学系には、結像光学系を通る、n個の点の1つにそれぞれ属する光路についての経路情報を、光度情報に変換する少なくとも1つの素子が設けられている。そのために、連続的に位置依存的なものであれ離散的に位置依存的なものであれ、位置依存的な透過性をもつ光学素子を使用すると格別に有利である。換言すると、

n 個の点の位置の、n 個の分離された参照位置とのずれを測定する本発明の装置は、並列処理をする光学距離計とも呼ぶことができる。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0019

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0019】

図2は、版、したがって反射点の位置の相異が、本発明の装置によってどのようにして異なる光路につながるかを説明するための概略図を示している。話を単純化するために、普遍性を制限することなく、本発明の装置のサジタル断面、すなわち光断面6によって規定される直線に対して垂直な断面だけを示している。光線21は、左から来て光学軸22と平行に伝搬する。レンズ23によって、光線21は光学軸22の方に向かって屈折する。作業点または参照位置としては、平面25と光学軸22の交点が考えられる。光線21がメリジオナル方向とサジタル方向で異なる半軸を有している一般的なケースでは、平面25に光カーペット24が生じる。平面25で反射された光は、レンズ23によって、光学軸22と平行に伝搬するビーム26に再び変換される。レンズ23で屈折された光線21は、レンズ23と参照平面25の間に位置する平面27と光カーペット28で交わる。光カーペット28で反射された光はレンズ23によって、光学軸22に沿って平行に伝搬するビーム29に変換される。光学軸に対するビーム29の間隔は、ビーム26の間隔よりも短い。平面25よりもさらにレンズ23から遠く離れて位置する平面210とは、レンズ23で屈折された光線21が光カーペット211で交わる。光カーペット211から出していく光はレンズ23によって、光学軸22に沿って平行に伝搬するビーム212に変換される。光学軸に対するビーム212の間隔は、ビーム26の間隔よりも大きい。図2からわかるように、図示した構成では、参照平面25の前後にある平面の位置、したがって間隔が、各平面で反射された光が変換されて結像光学系から出していく平行ビームから光学軸22までの間隔と、関数の関係にある。換言すれば、参照平面25に対する平面27または210の位置情報が、平行なビーム26, 29、および212の間隔という経路情報に変換される。このような経路情報は、光学軸22との間隔に応じた透過性を有している光学素子213によって、ビーム26, 29および212の光度としてコーディングされる。たとえば位置に応じた透過性213をもつ光学素子を通過した後、有利なことに光線214は光線215よりも低い強度を有しており、光線215は光線216よりも低い強度を有している。換言すれば、光学軸に対する平行ビームの位置に含まれている経路情報が強度情報に変換されるので、光線214, 215、および216を、ここには図示しない結像光学系によって、ここには図示しない検出器に投影することができ、その際反射平面の位置に関する情報はそのまま維持される。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0020

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0020】

図1に示す本発明の装置の有利な実施形態によって、図2を参照して説明した、位置から経路を経て強度になる情報変換が、n個の点Pすべてについて並列に実行される。そのために図1の光学結像系は、サジタル方向とメリジオナル方向で異なる半軸を有する光カーペット6を版5の上に生成する結像光学系である。このとき光カーペット6の面は、画像付け装置のn個の画点Pによって規定される面を覆う。光カーペット6で反射された光は、結像光学系によって検出器面10に投影され、これらの面の個々の部分がそれぞれn個のフォトダイオード11の各々に割り当てられる。換言すると、検出器では、光断面6の投影された画像が少なくともn個の部分に離散させられて、n個の点のうちそれぞれ2

つが位置する個々の領域の間で判別が行われる。このとき各々の部分に、画像付け装置の光源の  $n$  個の画点  $P$  の 1 つが一義的に割り当てられる。つまり時間的に実質的に同時に、すなわち特に検出器の応答挙動の範囲内で同時にまたは並行して、信号が検出器によって生成され、このとき  $n$  個の信号の各々に、 $n$  個の点の 1 つが一義的に割り当てられる。そこで、光断面 6 の各部分が対物レンズ光学系 4 に対して異なる距離を有していると、換言すれば、位置が参照平面の位置と異なっている平面で反射が行われると、本発明の装置の内部でこの部分に、関数関係にある相応の強度情報が割り当てられる。このようにして、並列処理の光学距離測定が可能となる。

#### 【手続補正 5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0022

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0022】

図 4 には、空間軸からの間隔に応じて段階的な透過性をもつ光学素子を備える、本発明の装置の別の有利な実施形態が概略的に示されている。0 と 1 の段階的な透過性が格別に有利である。このような種類の透過性を利用するため、光線 7 は、参照位置にある版 5 の光断面 6 に当たって反射したときに、光線の半分が透過段階 0 によってフェードアウトされるように広げられる。反射平面の位置のずれは、すでに述べたように、反射された平行ビームの位置情報に変換される。つまり光学軸 OA に対する、反射された平行ビームの間隔に応じて、透過段階 0 によって光線全体の多くの割合がフェードアウトされたり、少ない割合がフェードアウトされたりする。このようにして、強度情報が光線に含まれることになる。透過された光はすべて検出器に投影され、すなわち集束されるので、縁部での屈折や、フレネル積分に基づく強度変調など、コヒーレントな光の場合におけるコヒーレント効果は無視することができる。

#### 【手続補正 6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0032

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0032】

図 6 は、光カーペットが反射線として版の上でどのように生成され、位置情報が、反射された光の経路情報にどのように変換されるかを説明するための概略的な図である。図 6 は、ここでは一例として  $45^\circ$  の角度で版に当たり、入射方向に対して実質的に直角に反射される照明ビーム 601 を示している。版は、 $z$  方向、すなわち法線方向 603 に異なる位置を有することができる。第 1 の位置の版 608 では第 1 の交線 602 が生成され、版 609 の第 2 の位置では第 2 の交線 604 が生成され、版 608 の第 3 の位置では第 3 の交線 606 が生成される。一例として図 6 では、照明ビーム 601 の交線 604 がビーム 612 として反射される位置に版 608 がある状況が図示されている。版 608 がなければ、このビームは照明ビーム 605 として続いているはずである。一例として図示した 3 本の交線 602, 604 および 606 は、1 つの線平面 610 に位置している。換言すると、版 608 がその位置を  $z$  方向、すなわち法線方向 603 に変えると、交線 602, 604、または 606 の考えられる位置は、照明ビームの入射方向と、交線のうちの 1 本、たとえば第 2 の交線 604 とによって規定される平面を空間内に形成する。

#### 【手続補正 7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0033

【補正方法】変更

【補正の内容】

## 【 0 0 3 3 】

図7を参照しながら、本発明の装置における位置情報から強度情報への変化について概略的な図面で説明する。図7は、版701の上で光断面702がどのように位置しているかを模式的に示している。矢印で図示している反射変換によって、光断面702の位置が、線平面705で反射されたビーム704の経路情報に変換される。結像変換706は、この情報を変換平面707に画像スポット708として伝達する。変換平面707は、位置に応じた透過性をもつ光学素子709を有している。この光学素子709は、感光性の検出器712のフォトダイオード713上の検出平面711で特定の光強度が測定されるように、強度変換を引き起こす。信号変換714は、個々のフォトダイオード713の測定に応じて明度信号715を生成するために行われる。それにより、光断面の内部の個々の領域についての信号716が、位置の関数として生成される。そして明度信号715に含まれる情報は、画像付けビームの光学パラメータを版の起伏に適合させる装置に、制御信号として直列または並列に伝達される。